

Lecksuch- und Vakuumtechnik

Categories : [Messtechnik & Analytik](#)

Date : 17. Mai 2022

Pfeiffer Vacuum, einer der weltweit führenden Anbieter von Vakuum- und Lecksuchlösungen für die Halbleiterindustrie sowie für die Märkte Analytik, Industrie und Forschung & Entwicklung, hat am 13. Mai eine neue, 3.700 Quadratmeter große Anlage eröffnet. Die moderne Betriebsstätte befindet sich in Indianapolis, Indiana, USA.

Hier werden nordamerikanische Kunden in allen technischen Fragen rund um Lecksuche und Hochvakuumtechnik unterstützt. Der Schwerpunkt liegt auf Halbleiteranwendungen, medizinischen Geräten, Unterhaltungselektronik, Pharmazie, Automotive und Industrie. Das neue Gebäude beherbergt eine CNC-Maschinenhalle und modulare Montagebereiche für Lecksuchgeräte mit Luft und Helium sowie für kundenspezifische Vakuumsysteme.

Kompetenzzentrum für Lecksuche

Ein neues Anwendungslabor bietet den Kunden mit persönlichen oder interaktiven Schulungen und Vorführungen großen Mehrwert. Kunden können hier Teile mit allen Pfeiffer Vacuum Lecksuchtechnologien wie Luft-, Helium- und Wasserstoffprüfverfahren testen lassen und feststellen, welche Methode für ihre Anwendung am besten geeignet ist. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch interaktive Fernschulungen an, damit Kunden den Einsatz des Lecksuch-Equipments von Pfeiffer Vacuum bequem erlernen können.

Kundenspezifische Vakuumlösungen

Zusätzlich zum Kompetenzzentrum für Lecksuche hat Pfeiffer Vacuum ein Team für kundenspezifische Vakuumlösungen geschaffen, das für Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Schulungen verantwortlich ist. Zu den kundenspezifischen Vakuumsystemen gehören Pumpen, Druckmessgeräte, Gasanalysatoren, Lecksucher sowie ein umfassendes Sortiment von Komponenten, Ventilen und kundenspezifischen Kammern. Um die Leistung des Systems zu gewährleisten, werden Vakuumschulungen und Vor-Ort-Service angeboten.

Energiebewusste Gebäudegestaltung

Das neue Gebäude folgt außerdem dem Nachhaltigkeitsansatz von Pfeiffer Vacuum.